



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205996546 U

(45)授权公告日 2017.03.08

(21)申请号 201620823349.X

(22)申请日 2016.07.30

(73)专利权人 合肥凡艺精密模具有限公司

地址 230031 安徽省合肥市高新区宁西路  
24号凯创工业园

(72)发明人 曹枝 曹志雷

(51)Int.Cl.

B23Q 1/01(2006.01)

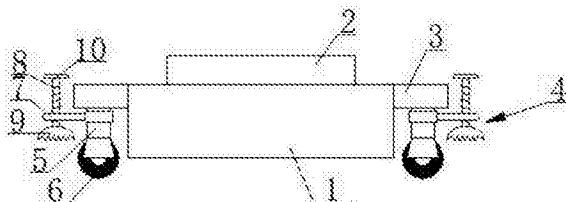
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种移动式数控机床基座

(57)摘要

本实用新型公开了一种移动式数控机床基座，它涉及机械加工技术领域。它包括方槽、基座和固定座，所述基座安装在方槽内，基座与方槽之间形成一个环形容纳空间；所述方槽开口边缘的四角处均安装有固定座，固定座的下端设置有可防滑的移动部件；所述可防滑的移动部件包括支撑柱，支撑柱的底部安装有滚轮，支撑柱上端固定安装有支撑板，支撑板的自由端开设有小孔，小孔中插入有螺杆，小孔的内螺纹与螺杆的外螺纹相配合；所述螺杆的底部安装有防滑抓齿。本实用新型结构简单，设计合理，既可收集加工时产生的废物，保护工作环境的清洁，又可对基座起到稳定防滑作用，大大提高了机床加工的精度。



1. 一种移动式数控机床基座，其特征在于，包括方槽、基座和固定座，所述基座安装在方槽内，基座与方槽之间形成一个环形容纳空间；所述方槽开口边缘的四角处均安装有固定座，固定座的下端设置有可防滑的移动部件；所述可防滑的移动部件包括支撑柱，支撑柱的底部安装有滚轮，支撑柱上端固定安装有支撑板，支撑板的自由端开设有小孔，小孔中插入有螺杆，小孔的内螺纹与螺杆的外螺纹相配合；所述螺杆的底部安装有防滑抓齿。

2. 根据权利要求1所述的移动式数控机床基座，其特征在于，所述螺杆的顶部安装有可拆卸的旋转轮。

3. 根据权利要求1所述的移动式数控机床基座，其特征在于，所述基座的顶面高于方槽的开口边缘。

## 一种移动式数控机床基座

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械加工技术领域,具体涉及一种移动式数控机床基座。

### 背景技术

[0002] 数控机床是计算机数字控制机床的简称,是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑的处理具有控制编码或其它符号指令规定的程序,通过计算机将其译码,从而使机床执行规定好了的动作,通过刀具切削将毛坯料加工成半成品或者成品零件。

[0003] 现有的可移动的数控机床基座大多是通过在基座上安装滚轮来实现位移;但是在加工过程中,由于机床加工产生的震动会使得滚轮有些许滑动位移,从而影响到机床的精度,不利于加工出高质量的产品;另外,现有的移动式基座不能够收集数控机床加工时产生的废屑和冷却废液等废物,这样往往会影响周围的工作环境。

### 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种既可收集加工时产生的废物,又可对基座起到稳定防滑作用的移动式数控机床基座。

[0005] 本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:

[0006] 一种移动式数控机床基座,包括方槽、基座和固定座,所述基座安装在方槽内,基座与方槽之间形成一个环形容纳空间;所述方槽开口边缘的四角处均安装有固定座,固定座的下端设置有可防滑的移动部件;所述可防滑的移动部件包括支撑柱,支撑柱的底部安装有滚轮,支撑柱上端固定安装有支撑板,支撑板的自由端开设有小孔,小孔中插入有螺杆,小孔的内螺纹与螺杆的外螺纹相配合;所述螺杆的底部安装有防滑抓齿。

[0007] 通过上述技术方案,基座与方槽之间形成的环形容纳空间可以收集数控机床加工时产生的废物,加工完成后可集中处理,避免污染周围的工作环境;设置的防滑抓齿在钻孔作业时,可通过螺杆旋转移动至与地面紧贴接触,利用防滑抓齿与地面的摩擦力对钻床起到稳定防滑的作用,有利于提高机床加工时的精度。

[0008] 进一步地,所述螺杆的顶部安装有可拆卸的旋转轮。

[0009] 通过上述技术方案,旋转轮可方便省力的对螺杆进行旋转,可拆卸的旋转轮以便更换受损的部件。

[0010] 进一步地,所述基座的顶面高于方槽的开口边缘。

[0011] 通过上述技术方案,可避免方槽内的废屑和冷却废液污染或腐蚀到基座上的数控机床。

[0012] 本实用新型的有益效果在于:

[0013] 本实用新型结构简单,设计合理,既可收集加工时产生的废物,保护工作环境的清洁,又可对基座起到稳定防滑作用,大大提高了机床加工的精度。

### 附图说明

[0014] 图1是本实施例的主视图；

[0015] 图2是本实施例的俯视图。

[0016] 图中编号说明：

[0017] 1-方槽；2-基座；3-固定座；4-可防滑的移动部件；5-支撑柱；6-滚轮；7-支撑板；8-螺杆；9-防滑抓齿；10-旋转轮；11-环形容纳空间。

### 具体实施方式

[0018] 参看图1~2，本实用新型具体实施方式采用以下技术方案：一种移动式数控机床基座，包括方槽1、基座2和固定座3，基座1安装在方槽2内，基座1与方槽2之间形成一个环形容纳空间11；其中，基座2的顶面高于方槽1的开口边缘；方槽1开口边缘的四角处均安装有固定座3，固定座3的下端设置有可防滑的移动部件4；可防滑的移动部件4包括支撑柱5，支撑柱5的底部安装有滚轮6，支撑柱5上端固定安装有支撑板7，支撑板7的自由端开设有小孔，小孔中插入有螺杆8，小孔的内螺纹与螺杆8的外螺纹相配合；螺杆8的底部安装有防滑抓齿9，螺杆8的顶部安装有可拆卸的旋转轮10。

[0019] 根据上述构造，工作时，操作者通过旋转轮10将螺杆8向下旋转移动，使得防滑抓齿9紧贴地面，利用防滑抓齿9与地面的摩擦力对基座起到稳定防滑的作用；在加工过程中，数控机床上产生的工件废屑和冷却废液等废物会落入到环形容纳空间11内，不会污染到周围的工作环境；待在加工作业完成后，操作者通过旋转轮10将螺杆8向上旋转移动，使得防滑抓齿9脱离地面，从而不妨碍滚轮6的移动。

[0020] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

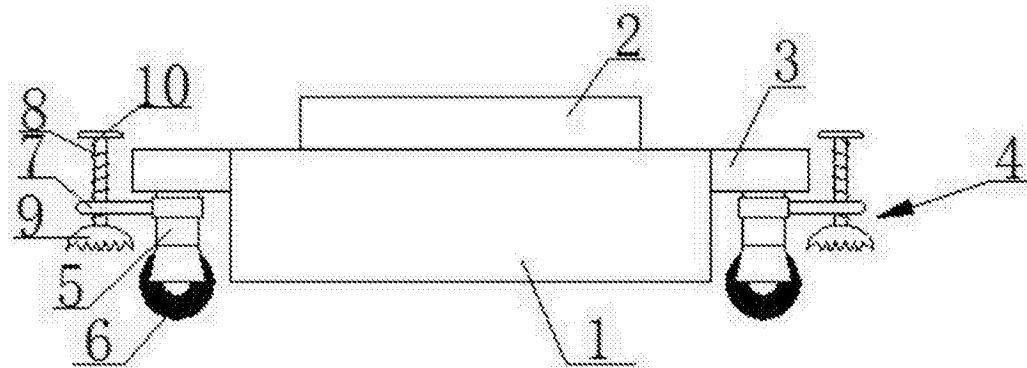


图1

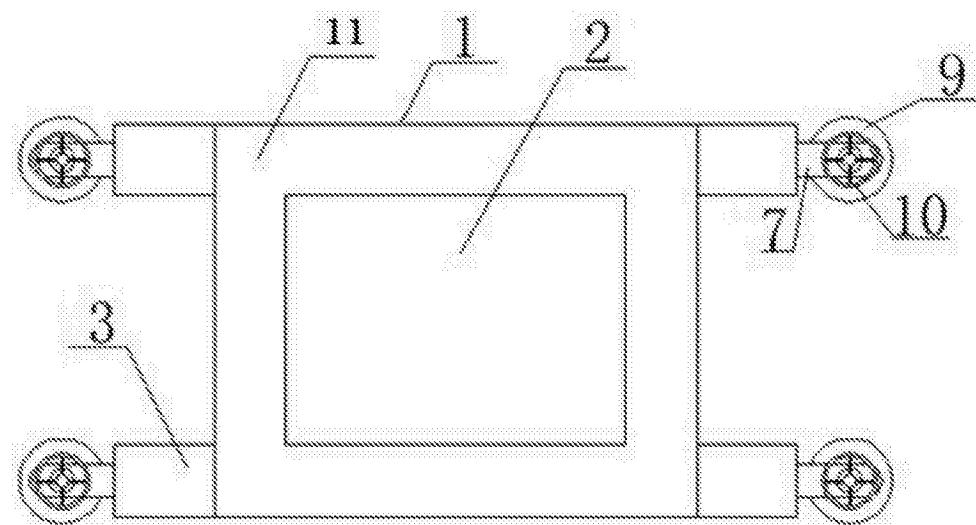


图2